

Lebenslauf



Persönliche Daten

Name: Dr. Matthias Esselbach
Anschrift: Magdelstieg 9, 07745 Jena
Geburtsdatum: 30.10.1969 (Saalfeld)
Familienstand: verheiratet, 2 Töchter
Staatsangehörigkeit: deutsch

Schulischer Bildungsweg

1976-1986 Polytechnische Oberschule Könitz
1986-1988 Erweiterte Oberschule in Saalfeld, Abitur „Mit Auszeichnung“
1988-1989 Wehrdienst

Studium und Promotion

1989-1991 Studium der Physik an der Technischen Hochschule Merseburg, Schwerpunkt Polymerphysik, Abschluß mit Vordiplom
1991-1994 Fortsetzung des Physikstudiums an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit den Schwerpunkten Angewandte Optik und Kristallphysik, Diplomarbeit zum Thema: „Experimentelle Untersuchungen zum Zeitverhalten selbstgepumpter phasenkonjugierender Spiegel“
Januar 1995 Abschluß des Studiums als Diplomphysiker, Diplomnote: „**Sehr gut**“
1995-2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Optik der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Spezialgebiete: optische Meßtechnik, optische Informationsverarbeitung und Informationsspeicherung, nichtlineare Optik und Wellenleiter, Dissertation zum Thema: „Optische Speicherung und Verarbeitung von Information mit photorefraktiven Medien“, Promotion mit dem Prädikat „**magna cum laude**“

Berufliche Tätigkeit

Mai 2000 Entwickler bei CARL ZEISS JENA im Bereich Mikroelektronische Systeme und dort im Geschäftsfeld Waferinspektionssysteme, Beschäftigung mit Justagestrategien, Thermalkonzepten, Messgeräte-Entwicklung, Schichtuntersuchungen und Konstruktionsthemen
November 2000 Leitung des Labors für Beleuchtungssystementwicklung bei der Zeiss-Tochter HENSOLDT in Wetzlar

Mai 2001	Entwicklungsprojektleiter für ein Beleuchtungssystem im UV- und DUV-Bereich zum Einsatz in Inspektionsgeräte für den Halbleitermarkt, zusätzlich Übernahme von Verantwortung für übergreifende Entwicklungsthemen des Gesamtsystems und für den Kontakt zum Kunden
2002	Entwicklungsprojektleiter für das Beleuchtungssystem eines Masken-Inspektionsgerätes im EUV (13.5 nm) nunmehr bei der Zeiss Tochter CARL ZEISS MICROELECTRONIC SYSTEMS GmbH, inklusive der Koordinierung der Beziehungen zu Lieferanten
2003	Zusätzliche Übernahme von Projektverantwortung für die Spezifikation, die Abnahme und den Versand von Geräten für die optische Inspektion von Halbleiter-Projektionsmasken bei 157nm einschließlich des intensiven Kundenkontaktes und für die Automatisierung von Meßsystemen
2004	Programmleiter bei der JENOPTIK Laser, Optik, Systeme GmbH, Verantwortung für den Bereich Infraroptik, Wehr- und Sicherheitstechnik
2011	Leiter der Abteilung Projektmanagement der JENOPTIK Optical Systems GmbH
Seit Oktober 2012	Kundenprojektmanager und operativer Produktmanager bei der CARL ZEISS SEMICONDUCTOR METROLOGY SYSTEMS GmbH

Spezielle Kenntnisse

- **Zertifizierter Projektmanagement-Fachmann** (Zertifiziert von der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.)
- Technische und physikalische Optik
- Optische Meßtechnik und Interferometrie
- Holographische Aufzeichnungstechniken
- Programmierung in Matlab, Maple und C
- Standardbürosoftware, etwas SAP
- Englisch fließend in Wort und Schrift, TOEFL
- Russisch Umgangssprache in Wort und Schrift mit Praxiserfahrung

Jena, im Oktober 2012

Dr. Matthias Esselbach